

開示の要約

表面性状測定システム、表面性状測定方法、研磨装置、および研磨方法

- 5 研磨パッドを傷つけることなく、かつ研磨処理全体のスループットを低下させることなく、研磨パッドの表面性状を精度よく測定することができる表面性状測定システムが開示される。表面性状測定システムは、回転する研磨パッドの研磨面に光を照射し、研磨面からの反射光に基づいて研磨パッドの表面性状を測定する光学的測定装置と、光学的測定装置と研磨パッドの間に配置されたカバー部材と、カバー
- 10 部材に設けられた注入口に連結され、注入口を通じて研磨パッド上に透明液を供給する透明液供給ラインを備え、カバー部材は、光および反射光の光路上に光透過部を有する、表面性状測定システム。

図 9